

# 多点監視用パーティクルセンサ KA-82

0.1  $\mu\text{m}$ 、リアルタイムモニタリング用センサ

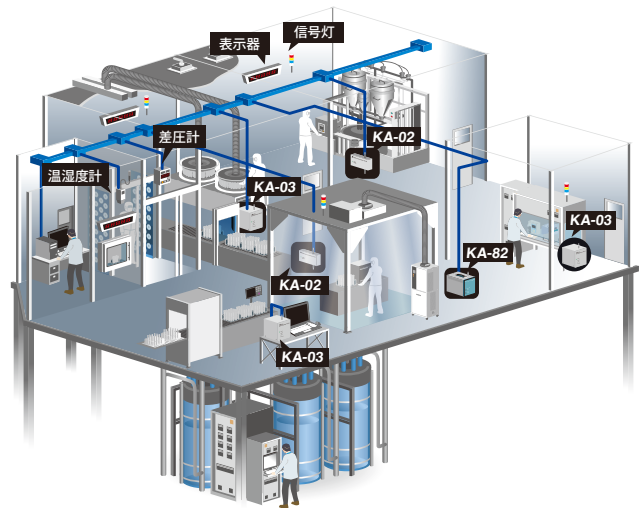


- クリーンルームの常時・同時多点モニタリングが可能
- モニタリングポイントの設置・変更、レイアウト変更に対応
- ポンプ内蔵型。各測定点に直接設置が可能
- 多点モニタリングシステムに対応 (RPモニタ Evo10 K1701 Ver. 3で160ポイント)

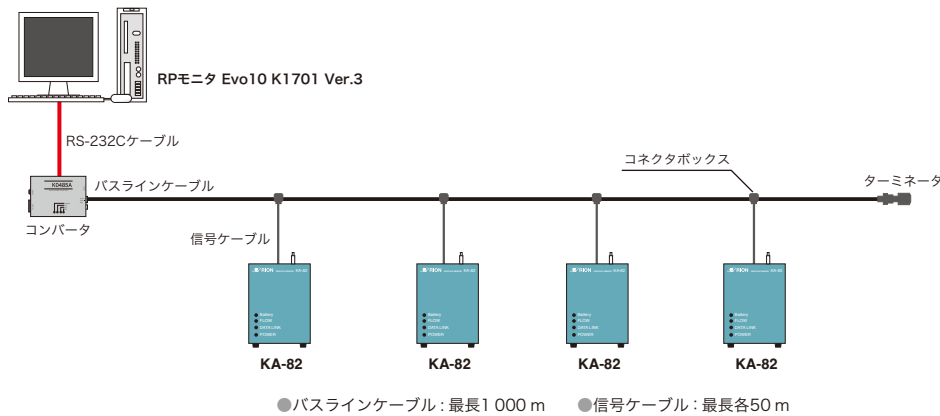
## 仕様 [KA-82]

光学方式	側方散乱方式
光源	半導体レーザー励起固体レーザー (波長: 1 064 nm) オープンキャビティ型 半導体レーザー (波長: 800 nm, 定格出力: 1 W) 固体レーザー (Nd:YVO <sub>4</sub> )
レーザー製品のクラス	クラス1, IEC 60825-1
受光素子	フォトダイオード
定格流量	2.83 L/min
最小可測粒径	0.1 μm (屈折率1.6の球形粒子の時)
粒径区分 (5段階)	0.1 μm以上, 0.15 μm以上, 0.2 μm以上, 0.3 μm以上, 0.5 μm以上
最大粒子個数濃度	10 000個/L (計数損失5%以内)
入出力端子	
ALARM 1端子 / ALARM 2端子	アラーム出力用端子 (接続最大負荷 DC30 V, 1 A) DATA LINK端子を介してアラーム出力の指示を受けると端子間がリレー接点により短絡
DATA LINK端子	多点システム用インターフェース
電源	AC100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 約100 VA
大きさ・重さ	185(H) × 155(W) × 330(D) mm (突起部を除く) ・約7.5 kg
付属品	サンプリング管 × 1 サンプリングチューブ (2 m) × 1 電源コード (日本国内にてAC100 Vで使用可能, 2.5 m) × 1

## センサ多点モニタリングシステム 構成例



## センサ多点モニタリングシステム 接続例 (RPモニタ Evo10 K1701 Ver.3の場合)

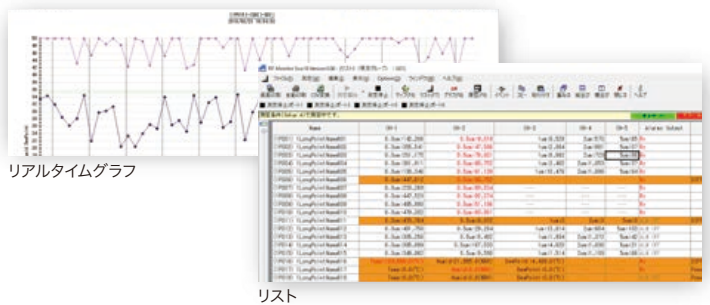


## RPモニタ Evo10 K1701 Ver.3

オプション



- パーティクルカウンタの制御、自動運転、データ収集、表示、ファイリング、印字が行えます。
- シリアルモードのパーティクルカウンタと、MultiモードRのパーティクルカウンタを最大32台 (拡張160台接続) まで同時に制御可能
- 対応OS: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit / 11 Pro 64 bit



**リオン株式会社** <https://www.rion.co.jp/>

\*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。  
\*本カタログ掲載の各製品のデザイン、仕様などは予告なく変更する場合があります。

### 製品の販売に関するお問い合わせ

本社 微粒子計測器事業部 営業部  
〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号  
TEL(042)359-7878 FAX(042)359-7445

九州リオン(株)  
〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号  
TEL(092)281-5366 FAX(092)291-2847

### メンテナンスに関するお問い合わせ

本社 微粒子計測器事業部 サービス窓口  
〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号  
TEL(042)359-7835 FAX(042)359-7445